

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Я. С. Гродзенский. Применение подхода Кифера–Вейсса для контроля технологических процессов	3
--	---

### НАНОМЕТРОЛОГИЯ

Г. Г. Левин, Я. А. Илюшин, С. Ю. Золотаревский, С. А. Кононогов. Моделирование процессов рассеяния оптического излучения наноразмерными структурами	7
---	---

### ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

О. Г. Быкова, А. А. Либерман, М. В. Улановский. Стандартизованные методики измерений мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка	15
--	----

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В. П. Шевчук, И. А. Болдырев. Метрологические характеристики информационно-измерительной системы для определения степени насыщения абсорбента	31
---	----

Перечень статей, опубликованных в 2009 г.	41
---	----

Алфавитный указатель	45
----------------------	----

## CONTENTS

### GENERAL PROBLEMS OF METROLOGY AND MEASUREMENT TECHNIQUES

Ya. S. Grodzenskiy. Kiefer–Weiss approach application for the technological process control	3
---	---

### NANOMETROLOGY

G. G. Levin, Ya. A. Ilyushin, S. Yu. Zolotarevskiy, S. A. Kononogov. Modelling processes of dispersion optical radiation of nanodimension structures	7
--	---

### OPTICOPHYSICAL MEASUREMENTS

O. G. Bykova, A. A. Liberman, M. V. Ulanovskiy. Standardized method for measurements of laser beam power, energy and temporal characteristics	15
---	----

### PHYSICOCHEMICAL MEASUREMENTS

V. P. Shevchuk, I. A. Boldyrev. Information and measuring system metrological characteristics for determination of absorbent saturation degree	31
--	----

Tables of contents	41
--------------------	----

Author index number 1 – 12	45
----------------------------	----